Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

364/03 **ПРИКАЗ** 17.04.2018

Екатеринбург

О закреплении оборудования за УЦКП СН УрФУ

В целях улучшения, укрепления и развития материально-технической базы научных исследований, обеспечения потребности Уральского федерального университета, институтов Уральского отделения РАН и других организаций Уральского региона в проведении фундаментальных и прикладных научных работ в области физического материаловедения, разработки технологий получения перспективных материалов на оборудовании, соответствующем мировому уровню, а также для концентрации финансовых и инженерных ресурсов для приобретения и обслуживания указанного оборудования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень современного уникального научного и технологического оборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области нанотехнологий, используемого УЦКП СН (Приложение 1).
2. Отменить действие п.1 приказа ректора от 29 марта 2017 г. №303/03.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по науке Кружаева В.В.

Ректор В.А. Кокшаров

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом ректора
от 17.04.2018 № 364/03

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
для закрепления за УЦКП «Современные нанотехнологии»

№	Наименование единицы оборудования	Фирма изготовитель, страна, год выпуска	Ответственное лицо	Комната №
	Аналитическое оборудование - Микроскопия			
1.	Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Aura	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Шур В.Я.	109
2.	Сканирующий зондовый микроскоп MFP 3D SA	Asylum Research, США, 2013	Шур В.Я.	126
3.	Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Spectra	ЗАО «НТ-МДТ», Россия, 2007	Шур В.Я.	109
4.	Система конфокальной микроскопии комбинационного рассеяния Alpha 300 AR	WiTec, Германия, 2012	Шур В.Я.	122
5.	Сканирующий зондовый микроскоп-нанотвердомер НаноСкан-4Д	ФГБНУ ТИСНУМ, Россия	Шур В.Я.	109
6.	Аналитический комплекс для исследований химических и физических свойств материалов с системой для подготовки образцов и улучшения контраста сканирующей электронной микроскопии и микроанализа Auriga CrossBeam	Carl Zeiss, Германия, 2010	Шур В.Я.	124
7.	Микроскоп электронный автоэмиссионный сканирующий Merlin	Carl Zeiss, Германия, 2016	Шур В.Я.	126
8.	Сканирующий электронный микроскоп EVO LS 10	Carl Zeiss, Германия, 2014	Шур В.Я.	113
	Аналитическое оборудование - Анализаторы			
9.	Анализатор площади поверхности и пористости TriStar 3000	Micromeritics, США, 2007	Вшивков С.А.	214
10.	Прибор синхронного DCK/DTA термоанализатор STA 409 PC Luxx	Netzsh, Германия, 2007	Черепанов В.А.	417
11.	Прибор синхронного DCK/DTA термогравиметрический анализатор PYRIS 1 TGA	Perkin-Elmer, США, 2008	Анимица И.Е.	406
12.	Высокотемпературный дилатометр DIL 402C	Netzsh, Германия, 2007	Черепанов В.А.	318
	Аналитическое оборудование - Спектрометрия			
13.	Хромато-масс-спектрометр гибридный квадрупольный Xevo QTof UPLC	Waters, США, 2010	Киселева И.С.	158а
14.	Газоаналитическая система на основе квадрупольного масс-спектрометра STA 409 Luxx/QMS 403 C	Netzsh, Германия, 2007	Анимица И.Е.	414
15.	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6500 Duo	Thermo Scientific, США, 2007	Неудачина Л.К.	309

16.	Атомно-абсорбционный спектрометр Solaar 6M	Thermo Scientific, США, 2007	Неудачина Л.К.	309
17.	Комплекс оптической спектрометрии			
	ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700	Thermo Scientific, США, 2008	Неудачина Л.К.	307
	Спектрофлюориметр Флюорат-02-Панорама	Люмэкс, Россия	Неудачина Л.К.	307
	Двухлучевой прецизионный спектрофотометр Agilent Cary 5000	Agilent Technologies Inc., США, 2013	Шур В.Я.	126
18.	Рентгенофлуоресцентный спектрометр на полном внутреннем отражении Nanohunter	Rigaku Corp., Япония, 2010	Васьковский В.О.	284
19.	Спектрометр рентгеновский фотоэлектронный многофункциональный K-ALPHA	Thermo Fisher Scientific, Великобритания, 2015	Шур В.Я.	113
	Аналитическое оборудование – Магнитометрия			
20.	СКВИД-магнитометр MPMS XL7	Quantum Design, США, 2008	Кудреватых Н.В.	278
21.	Комплекс оборудования для магнитных измерений			
	Магнитометр вибрационный 7407 VSM	Lake Shore Cryotronics, США, 2013	Кудреватых Н.В.	285
	Измеритель свойств постоянных магнитов Permagraf-L	Magnet Physik GmbH, Германия, 2012	Кудреватых Н.В.	283
	Магнитооптический Керр-микроскоп Evico	Evico magnetics, Германия, 2015	Васьковский В.О.	373
	Установка автоматизированная для измерения магнитокалорического эффекта MagEq MMS	ПМТиК, Россия, 2015	Васьковский В.О.	375
22.	Спектрометр электронного парамагнитного и двойного электронно-ядерного резонансов EMX Plus	Bruker, Германия, 2007	Важенин В.А.	103
	Аналитическое оборудование – Прочее			
23.	Дифрактометр порошковый рентгеновский XRD 7000S	Shimadzu, Япония, 2014	Черепанов В.А.	102в
24.	Электромеханическая испытательная машина для исследования механических свойств материалов AG-50kNXD	Shimadzu, Япония, 2008	Баранов Н.В.	105
25.	Комплекс для измерения физических свойств материалов DMS-1000	Dryogenic, Англия, 2008	Баранов Н.В.	100
26.	Комплекс для исследования сегнетоэлектрических материалов			
	Многофункциональная система для измерения и анализа свойств сегнето, пиро, диэлектриков aixPES	aixACCT Systems GmbH, Германия, 2012	Шур В.Я.	215
	Оптический микроскоп с системой для высокоскоростной видеосъемки Olympus BX-61; FC13	Olympus, Япония, 2011 FastVision, США, 2007	Шур В.Я.	229
27.	Комплекс для измерения параметров лазерного излучения			
	Система FX50 BeamStar	Ophir, Израиль, 2007	Шур В.Я.	220
	Импульсный твердотельный лазер с гармониками Brilliant	Quantel, Франция, 2007	Шур В.Я.	220

	Технологическое оборудование			
28.	Система очистки воды Elix 10	Millipore, Франция, 2007	Шур В.Я.	213
29.	Комплекс для фотолитографии			
	Чистое производственное помещение класса ГОСТ ИСО5	СК РОСТ, Россия, 2007	Шур В.Я.	213
	Установка для нанесения и термической обработки резиста Sawatec SM180-HP250HDMS	Sawatec Solutions, Лихтенштейн, 2008	Шур В.Я.	213
	Установка совмещения фотошаблона и пластины SUSS MJB4	Suss MicroTec, Германия, 2008	Шур В.Я.	213
	Установка для очистки пластин, проявки и удаления резиста OPTIwet St30	SSE, Германия, 2008	Шур В.Я.	213
	Система контроля качества фотолитографии Olympus BX-51	Olympus, Япония, 2018	Шур В.Я.	213
30.	Установка реактивно-ионного травления Plasmalab 80 plus RIE	Oxford Instruments, Великобритания, 2008	Шур В.Я.	222
31.	Комплект вакуумной установки для электронно-лучевого испарения и магнетронного напыления Auto 500 Edwards	BOC Edw., Великобритания, 2008	Шур В.Я.	222
32.	Комплект вакуумной установки магнетронного распыления ATC Orion 8 UHV	AJA Int. Inc., США, 2008	Васьковский В.О.	275
33.	Лазерная система для обработки материалов на базе CO_2 лазера VL-300/40	ЦЛТ, Россия, 2008	Шур В.Я.	101
34.	Комплекс оборудования для синтеза коллоидных растворов наночастиц металлов			
	Система прецизионной лазерной маркировки МиниМаркер 2 - М20	ООО «Лазерный центр», Россия, 2017	Шур В.Я.	101
	Лазерная система для обработки материалов на базе волоконного лазера Fmark-20	ЦЛТ, Россия, 2008	Шур В.Я.	101
	Анализатор дисперсии наночастиц и растворов универсальный Zetasizer Nano	Malvern Instruments, Великобритания 2009	Шур В.Я.	101
	Камера инфракрасная H2640 (NEC)	NEC, Япония 2013	Шур В.Я.	101
35.	Комплекс для прецизионной механической обработки			
	Станок для прецизионной шлифовки и полировки PM5	Logitech, Великобритания, 2007	Шур В.Я.	231
	Автоматическая установка резки DAAD 3220	DISCO, Япония, 2014	Шур В.Я.	231
	Оптический профилометр Wyko NT 1100	Veeco Instruments Inc, США, 2007	Шур В.Я.	229
	Двухкоординатная комбинированная система бесконтактных измерений Kestrel-200/Peregrine	Vision Engineering Великобритания, 2010	Шур В.Я.	231
36.	Портальный трехкоординатный робот Janome JC-3A00-0H3 с системой дозирования TAEHA THE-200	ООО «Евроинтех» Россия, 2016	Шур В.Я.	153
37.	Интерферометрический измерительный комплекс Thorlabs	Thorlabs, США 2014	Шур В.Я.	06

СОГЛАСОВАНОВСЭД
ВМЕСТЕ С ОСНОВНЫМ
ДОКУМЕНТОМ